

貸付機械器具一覧

【R5.9.1現在】

機器番号	機器名	料金 (円/時間)
M100	旋盤	620
M102	帯のご盤	290
M103	小型平面研削盤	900
M106	精密切断機	580
M108	シグ中ぐりフライス盤	690
M109	NC放電加工機 (EA12E)	1,490
M111	雰囲気調整電気炉	1,990
M112	高周波誘導電気炉	1,520
M113	放電プラズマ焼結機	2,430
M114	高周波誘導式真空溶解炉	2,810
M115	粉末処理装置	150
M116	手動切断機	240
M117	試料埋込機	1,380
M118	自動研磨装置	3,730
M119	精密ワイヤ放電加工機	2,690
M121	高速加工機	3,220
M122	CAD/CAMシステム	700
M123	超高温電気炉	330
M124	真空含浸装置	700
M125	精密切断機(硬質・脆性材料切断)	1,100
M200	万能試験機	650
M201	精密万能試験機(250kN)	1,200
M203	表面性測定機	680
M204	内部欠陥判定装置	470
M205	ワックス物性試験機	180
M206	塩乾湿複合サイクル試験機装置	1,740
M207	シャルピー衝撃試験機	240
M208	高温顕微硬度計	2,450
M209	薄膜硬度計	560
M210	摩擦磨耗試験機	1,420
M211	高解像度ハイスピードカメラ	1,410
M212	表面粗さ測定装置	1,780
M214	CNC三次元測定機	4,450
M215	万能形状測定装置	1,040
M216	サーモグラフィ	910
M219	構造解析システム	1,710
M220	3次元湯流れ凝固解析システム	430
M222	測定顕微鏡	840
M223	万能投影機	370
M224	超微小硬さ試験機	550
M225	デジタル金属顕微鏡	610
M226	コンピュータ設計支援システム	500
M227	加工機制御用CAD/CAMシステム	790
M228	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム(計測処理)	8,250
M230	表面性状測定機	2,600
M231	高倍率型顕微鏡	600
M232	卓上型走査電子顕微鏡	2,310
M233	微細形状観察評価装置(レーザー顕微鏡)	1,990
M234	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム(ポスト処理)	950
M235	非接触3次元デジタル計測システム	2,020
M236	精密騒音計	350
M237	風量測定器	770

P100	サンプルカット用プロッタ	440
P101	3Dプリンタ①(材料持込)	840
P102	3Dプリンタ②(0.1mm)	1,120
P103	3Dプリンタ③(0.2mm)	1,380

機器番号	機器名	料金 (円/時間)
C100	射出成形機	1,780
C102	精密切断機	920
C104	マイクロカuttingマシン	540
C105	小型射出成形機	1,100
C106	油圧真空加熱プレス	1,410
C107	自転回転式攪拌脱泡装置	250
C200	FT赤外分光光度計	2,690
C201	X線回折装置	3,410
C203	静荷重試験機	1,590
C205	電界放出型走査電子顕微鏡(分析)	7,080
C206	電界放出型走査電子顕微鏡(観察)	5,960
C208	熱分析装置	2,080
C209	X線分析顕微鏡	2,110
C211	粉体特性評価装置	810
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	4,990
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	1,930
C214	混練性・押出性試験装置	3,930
C216	比表面積・細孔分布測定装置	790
C217	X線光電子分光分析装置	4,510
C218	イオンクロマトグラフ(陽イオン)	1,700
C219	イオンクロマトグラフ(陰イオン)	1,670
C220	イオンビームミリング装置(電子顕微鏡用試料作成装置)	2,090
C221	高周波プラズマ発光分析装置	3,530
C222	低温プラズマ分解装置	530
C223	マイクロサンプリングマシン	970
C225	マイクロ波分解装置	880
C226	誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)	2,700
C227	紫外可視分光光度計	180
C229	恒温恒湿器(新)	170
C230	卓上型pHメーター	420
C231	実体顕微鏡システム	180

W100	丸鋸昇降盤	200
W101	軸傾斜横挽丸鋸盤	190
W102	手押し鉋盤	220
W103	自動鉋盤	380
W104	定温乾燥機	310
W105	ディスクリファイナー	1,360
W106	ホットプレス	470
W107	恒温恒湿器	170

J100	電磁界解析ツール	720
J104	微小部X線応力測定装置	1,020
J105	三次元磁界ベクトル分布測定装置	170
J106	真空均温熱処理装置	640
J200	磁気シールドルーム	11,630
J201	ヘルムホルツコイル	330
J202	直流磁化測定装置	1,970
J203	ソレノイドコイル	520
J204	校正用機器	160
J205	ガウスメータ	250
J206	レーザドップラ振動計	1,630
J207	パワーアンプ	540
J208	パワーアナライザ	770

機器番号	機器名	料金 (円/時間)
F101	低温恒温恒湿機	360
F102	クリーンベンチ	210
F103	真空凍結乾燥機	1,350
F105	真空包装機	190
F106	低温高速遠心機	350
F107	プレハブ仕込室	190
F108	高温高圧調理殺菌装置	1,800
F111	細胞破碎装置	220
F112	微生物増殖装置	510
F117	スプレードライヤー	300
F118	高圧ホモジナイザー	370
F119	微細装置	610
F121	ホモジナイザー	160
F122	ロータリーエバポレーター	150
F200	水分活性測定装置	480
F201	測色色差計	390
F207	高速液体クロマトグラフ	1,320
F208	キャピラリーガスクロマトグラフ	740
F211	自記光電分光光度計	420
F212	原子吸光分析装置	840
F213	pHメーター	210
F214	密度比重計	150
F215	蛍光プレートリーダー	820
F216	高速液体クロマトグラフ質量分析計	5,940
F218	3次元観察顕微鏡	1,340

E100	スパッタリング装置	1,910
E104	真空熱処理装置	970
E200	高精度12bit型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	270
E204	分光光度計(電子材料分光特性評価装置)	580
E209	ネットワーク・アナライザ	590
E300	電波暗室	5,310
E301	雑音電界強度測定器	1,810
E302	雑音端子電圧測定器	1,720
E303	雑音電力測定器	1,670
E304	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	240
E305	放射イミュニティ試験器	2,230
E306	伝導イミュニティ試験器	1,310
E307	静電気試験器	300
E308	商用磁界試験器	450
E309	アンテナ計測システム	1,220
E310	オシロスコープ	310
E400	ドローンテスト用ネット	1,220

999	その他の機械器具	100
-----	----------	-----